強磁性金属を用いたオットー配置型表面プラズモンセンサにおける 金属の誘電率と検出特性の評価

Characterization of Refractive Index of Metal Thin Films and Sensitivity in Magnetooptic Surface Plasmon Resonance Sensors with Otto Configuration 東京農工大工 ⁰鈴木翔吾,下平貴大,清水大雅

Tokyo Univ. of Agri. & Tech., Shogo Suzuki, Takahiro Shimodaira, Hiromasa Shimizu E-mail: <u>s147723w@st.go.tuat.ac.jp</u>, <u>h-shmz@cc.tuat.ac.jp</u>

[はじめに]

表面プラズモンポラリトン(Surface Plasmon Polaritons; SPPs)とは金属と誘電体の界面に生じる自由電子の集団振 動と結合し界面に沿って伝搬する光波である。SPP の波数 と外部光の波数の進行方向成分を整合させ、励起すること を表面プラズモン共鳴(Surface Plasmon Resonance; SPR)と 呼ぶ。SPR の共鳴条件は界面を構成する金属と誘電体の屈 折率に強く依存するため、例えば、誘電体部にガスを導入 しその屈折率変化による SPR 共鳴条件の違いを測定する ことでガスセンサへの応用が可能である。これまで金属と して強磁性金属を組み込み、磁化を反転することで磁気光 学効果(Magnetooptic effect)を通じて共鳴条件の変調と波長 可変性を報告してきた^{II}。また、磁気的変調によるセンサ 感度の向上が報告されている^[2]。本研究では、図1に示す ように強磁性金属を用い、金属と誘電体の間の空間(厚され) に分析対象を導入する Otto 配置型^[3]の磁気表面プラズモン 共鳴センサ(Magnetooptic Surface Plasmon Resonance sensor; MOSPR センサ)を設計し、検出特性を求めたので報告する。 [金属の屈折率評価]

表面プラズモンセンサの設計では金属の複素屈折率 (N = n + ik)を把握する必要がある。センサを実現するための金属として、Au, Cu, Fe に着目し、ガラス基板上に電子ビーム蒸着によってこれらの薄膜を製膜し、反射率の入射角依存性を測定した。入射光は波長 λ =1.55 μm の p 偏光とした。また、金属の複素屈折率をパラメータとしたフレネル反射率の入射角依存性を定式化し、測定結果を再現するように金属の屈折率を求めた。測定結果とフィッティング結果を図2に示す。Au, Cu, Fe の屈折率はそれぞれ $N_{Au} = 0.170 + i9.37$, $N_{Cu} = 0.193 + i9.84$, $N_{Fe} = 3.08 + i4.13$ と求められた。

[MOSPR センサの設計と検出特性の評価]

強磁性金属による磁気的変調と貴金属による高感度特性 を両立するために図1に示すようにAuとFeの複合構造を 検討した。空間層、上部Au層、Fe層の膜厚をそれぞれ、 t_{Au} 、 t_{Fe} として、下部Au層の膜厚は150 nmとした。式(1)の反 射率の磁気的変調 $\Delta R/R$ を指標として定義した。空間層の 屈折率N = 1.0000のとき SPR 共鳴条件を満たし、かつ屈 折率変化($\Delta N = 0.0001$)に対する指標の変化 $\delta(\Delta R/R)$ が最 大となるように各膜厚を決定した結果t = 3200nm, $t_{Au} = 6$ nm, $t_{Fe} = 5$ nmとなった。上記構造において式(1), (2)で定義した $\Delta R/R$, $\delta(\Delta R/R)$ の入射角度依存性を計算した結果を図3に示す。このときAu, Feの複素屈折率は前述の値を用い、Feの誘電率非対角項は $\epsilon_{xy} = 3.12 - i1.80^{||}$ とした。入射角 $\theta_{in} = 44.29 \text{deg.}$ のとき $\delta(\Delta R/R) = 1.6$ と求められ、光検出器によって検出可能な値である。これは屈折率分解能 $\Delta N = 0.0001$ をもつセンサとして動作することを意味する。上記指標 $\delta(\Delta R/R)$ は従来の非磁性金属を用いたSPRセンサの指標である $\delta R = R_{N=1.0000} - R_{N=1.0001} = 0.15$ よりも大きく、従来のSPRセンサと比較して高い屈折率分解能が見込まれる。



図 3 MOSPRセンサに屈折率変化 $\Delta N = 10^4$ を与えた時の $\frac{\Delta R}{R}$,及び

$\delta\left(\frac{\Delta R}{R}\right)$ の計算結果

[参考文献] [1] T. Kaihara et al, Appl. Phys. Lett., **109** 111102 (2016). [2] D. Regatos et al, J.Appl.. Phys. **108**, 054502 (2010). [3] Y. Lee et al, Microsyst Technol **23** 1983-1989 (2017). [4] 貝原輝則,東京農工大学博士論文 (2017)